

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 6月10日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-165200

[ST. 10/C]:

[JP2003-165200]

出 願 人 Applicant(s):

昭和電工株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月27日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

P03372-010

【提出日】

平成15年 6月10日

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市川崎区千鳥町2番3号 昭和電工株式会

社内

【氏名】

齋 藤

信

隆

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市川崎区千鳥町2番3号 昭和電工株式会

社内

【氏名】

植田

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市川崎区千鳥町2番3号 昭和電工株式会

社内

【氏名】

谷 隆士

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市川崎区千鳥町2番3号 昭和電工株式会

社内

【氏名】

中 村 圭 一

【特許出願人】

【識別番号】

000002004

【氏名又は名称】

昭和電工株式会社

【代理人】

【識別番号】

100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴木 俊一郎



【選任した代理人】

【識別番号】 100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧 村 浩 次

【選任した代理人】

【識別番号】 100107043

【弁理士】

【氏名又は名称】 高 畑 ちより

【選任した代理人】

【識別番号】 100110917

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木 亨

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014535

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9815946

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 β-ジケトン化合物、その金属錯体および金属化合物の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)

(1)

(但し、 $R^{1} \sim R^{3}$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、Qはアルキル基を示す。)で表されるエステル化合物と式 (2)

(2)

$$CR^4R^5R^6COCH_2R^7$$

(但し、 $R^4 \sim R^6$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、 R^7 は、水素原子または炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基を示す。)で表されるケトン化合物とをアルカリ金属アルコキシド触媒の存在下に反応させる工程 1 を含むことを特徴とする式 (3)

$$CR^{1}R^{2}R^{3}COCHR^{7}COCR^{4}R^{5}R^{6}$$
(3)

(但し、 $R^{1}\sim R^{7}$ は、上記と同じ意味を示し、かつ $R^{1}\sim R^{6}$ の少なくとも一つは水素原子である。)で表される β ージケトン化合物の製造方法。

【請求項2】 式(1)

$$CR^{1}R^{2}R^{3}COOQ \qquad (1)$$

(但し、 $R^{1}\sim R^{3}$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1\sim 3$ のアルキル基を示し、Qはアルキル基を示す。)で表されるエステル化合物、アミド系溶媒および尿素系溶媒から選ばれる少なくとも1種以上の化合物を溶媒として使用することを特徴とする請求項1に記載の β -ジケトン化合物の製造方法。

【請求項3】請求項1において、式(1)で表される化合物がイソ酪酸アルキルエステルであり、式(2)で表される化合物が3-メチルプタノンであり、式(3)で表される化合物が2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンであることを特徴とする2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項4】 イソ酪酸アルキルエステルを溶媒として使用し、それ以外の溶媒を使用しないで反応させることを特徴とする請求項3に記載の2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオンの製造方法。



【請求項5】 溶媒としてアミド系溶媒または尿素系溶媒を使用することを特徴とする請求項3に記載の2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンの製造方法

【請求項 6 】 溶媒がN, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンおよび 1, 3-ジメチル-2-イミダブリジノンから選ばれる溶媒の 1 種または 2 種以上であることを特徴とする請求項 5 に記載の 2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項7】 溶媒がN, N-ジメチルホルムアミドおよび/または<math>1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノンであることを特徴とする請求項<math>6 に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項8】 溶媒使用量が3-メチルプタノンの3質量倍~30質量倍であることを特徴とする請求項4~7のいずれかに記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項9】 アルカリ金属アルコキシド触媒のアルカリ金属がナトリウムまたはカリウムであることを特徴とする請求項3~8のいずれかに記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項10】 アルカリ金属アルコキシド触媒のアルコール部分が3級のアルコールであることを特徴とする請求項9に記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項11】 アルカリ金属アルコキシド触媒の使用量が3-メチルプタノンに対して、 $1\sim10$ 倍モルであることを特徴とする請求項 $3\sim10$ のいずれかに記載の2, $6\sim$ ジメチル-3, $5\sim$ プタンジオンの製造方法。

【請求項12】 イソ酪酸アルキルエステルと3ーメチルブタノンとをアルカリ 金属アルコキシド触媒の存在下反応させ2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンを合成する工程1と2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンの反応液に 酸を加えて中和し、水を添加して2層分離させて2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンを油層として分離することにより単離する工程2を含むことを特徴とする請求項3~11のいずれかに記載の2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンの製造方法。



【請求項13】 酸が硫酸、塩酸および硝酸から選ばれる1種または2種以上であることを特徴とする請求項12に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法

【請求項14】 請求項12または13に記載の製造方法で得られた2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンを含む油層から、油層に含まれるイソ酪酸アルキルエステル、3-メチルブタノン、溶媒を蒸留により分離回収し、反応に再利用する2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

【請求項15】 請求項3~14のいずれかに記載の方法により得られた2,6 ージメチルー3,5-ヘプタンジオンと金属塩を反応させる工程3を含むことを 特徴とする2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項16】 金属塩が、金属のハロゲン化物、硝酸塩、硫酸塩およびリン酸塩からなる群の1種または2種以上であることを特徴とする請求項15に記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項17】 金属塩が、金属の塩化物および/または硝酸塩であることを特徴とする請求項16に記載の2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項18】 金属塩の金属が、遷移金属および/またはアルカリ土類金属の 1種または2種以上であることを特徴とする請求項15~17のいずれかに記載 の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項19】 金属が、アルカリ土類金属、希土類金属、Ti、Zr、Hf およびCuからなる群より選ばれた1種または2種以上であることを特徴とする請求項18に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項20】 2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンと金属塩との反応において、溶媒として親水性溶媒を使用することを特徴とする請求項 $15\sim19$ のいずれかに記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項21】 親水性溶媒が炭素数 $1\sim4$ 個のアルコール類であることを特徴とする請求項20に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオン金属錯体



の製造方法。

【請求項22】 アルコール類がメタノールであることを特徴とする請求項21 に記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項23】 反応終了後、水を添加して、2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体を析出させて、単離することを特徴とする請求項15~22のいずれかに記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項24】 2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオン金属錯体が、金属1原子に対し、2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオンが2~4分子配位している金属錯体であることを特徴とする請求項15~23のいずれかに記載の2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

【請求項25】 請求項 $15\sim24$ に記載の方法により得られた2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体を原料として、金属または金属化合物を製造することを特徴とする金属または金属化合物の製造方法。

【請求項26】 2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオン金属錯体を蒸気化して使用することを特徴とする請求項25に記載の金属または金属化合物の製造方法。

【請求項27】 化学気相成長法を用いることを特徴とする請求項26に記載の 金属または金属化合物の製造方法。

【請求項28】 金属または金属化合物が金属酸化物であることを特徴とする請求項25~27のいずれかに記載の金属酸化物の製造方法。

【請求項29】 金属酸化物が金属酸化物被膜であることを特徴とする請求項2 8に記載の金属酸化物被膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は例えばMOC V D (有機金属化学気相成長法、metalorganic chemica l vapor deposition) 原料などの揮発性有機金属錯体の配位子として有用な、 β ージケトン化合物、特に 2 , 6 ージメチルー 3 , 5 ーヘプタンジオン (DMHD)



と略すことがある。)の製造方法に関する。

[0002]

さらに、その2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンを使用した、2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法および該金属錯体を使用した金属または金属化合物の製造方法に関する。

[0003]

【従来の技術】

[0004]

2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオンの製造方法としては、クライゼン縮合による方法が良く知られている。例えばJ. Am. Chem. Soc., 66, 1220(1944)(非特許文献1)ではピバリン酸エチルエステルとピナコロン(3, 3ージメチルー2ープタノン、tertープチルメチルケトン)をナトリウムアミド触媒を用いて反応させ2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオンを収率28%で合成している。また、この報文では、ナトリウムエトキシドを用いた、メチルケトンとエステルとのアシル化反応も記載されているが、高級エステルを用いた場合には反応性に劣る旨が報告されている。

[0005]

また J. Org. Chem., 27, 1036 (1962) (非特許文献2) では水素化ナトリウム触媒でピバリン酸メチルエステルとピナコロンを反応させて2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオンを収率60~70% で合成している。

[0006]

2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオンの合成例としてはクライゼン縮合



反応を用いた報告例(非特許文献3、非特許文献4)があるが、何れも触媒として金属ナトリウムと同様に取り扱いの困難な水素化ナトリウムやナトリウムアミドを用いており安全上問題があり、またそれに付随した安全対策が必要であり、工業的に用い難い。

[0007]

その他マロン酸クロリドと t - B u M g C l (t - B u は t e r t - ブチル基) とのグリニャール反応による合成法や、 t - B u C u (L i) S P h との反応による合成法なども報告されているが、 - 70℃程度の極低温が必要で、且つ取り扱いも非常に難しいなど工業的実施には問題がある。

[0008]

このように 2, 6 ージメチルー 3, 5 ーヘプタンジオンを製造する操作が簡便で安価な工業的に有利な方法はこれまで知られておらず、更なる改善が望まれている。

[0009]

【非特許文献1】 J. Am. Chem. Soc., 66, 1220 (1944)

【非特許文献2】 J. Org. Chem., 27, 1036 (1962)

【非特許文献3】Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto Univ., vol. 46, No. 6, 256 (1968)

【非特許文献4】Mat. Res. Soc. Symp. Proc., vol. 4 95, 63 (1998)

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、式(3)

 $CR^{1}R^{2}R^{3}COCHR^{7}COCR^{4}R^{5}R^{6}$ (3)

(但し、 $R^{1}\sim R^{6}$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1\sim 3$ のアルキル基を示し、かつ $R^{1}\sim R^{6}$ の少なくとも一つは水素原子である。 R^{7} は、水素原子または炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を示す。)で表される β ージケトン化合物を得ることのできる工業的に有利な製造方法を提供することを課題の一つとする。

[0011]



特に、2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンを簡便かつ安価に得ることが出来る、工業的に有利な製造方法を提供することを課題の一つとする。

[0012]

より具体的には、本発明は、式(1)

$$CR^{1}R^{2}R^{3}COOQ \qquad (1)$$

(但し、 $R^{1}\sim R^{3}$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1\sim 3$ のアルキル基を示し、Qはアルキル基を示す。)で表されるエステル化合物と式(2)

$$CR^{4}R^{5}R^{6}COCH_{2}R^{7}$$
 (2)

(但し、 $R^4 \sim R^6$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、 R^7 は、水素原子または炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基を示す。)で表されるケトン化合物とを反応することにより、式(3)で表される β ージケトン化合物、特に 2 、6 ージメチルー 3 、5 ーヘプタンジオンを製造するに際し、アルカリ金属アルコキシド触媒を使用可能な方法を提供することを課題の一つとする。

[0013]

すなわち、イソ酪酸アルキルエステルと3-メチルブタノンを原料として2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンを製造するに際し、アルカリ金属アルコキシドを触媒として使用できる方法を提供することを課題の一つとする。

[0014]

また、上記のように製造した 2 , 6-ジメチルー 3 , 5-ヘプタンジオンと金属塩とを反応させ、 2 , 6-ジメチルー 3 , 5-ヘプタンジオン金属錯体を製造する方法と提供することを課題の一つとする。

[0015]

また、上記で製造した2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体を 用いた金属または金属化合物の製造方法を提供することを課題の一つとする。

[0016]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記の従来の問題点を解決すべく鋭意検討した結果、イソ酪酸アルキルエステルと3ーメチルブタノンとをイソ酪酸アルキルエステルを溶媒として使用し、反応当初にそれ以外の溶媒を使用しないで反応させるかまたはアミ



ド系または尿素系の溶媒中で反応させることにより、取り扱いの容易なアルカリ 金属アルコキシド触媒を用いて、2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンを 合成できることを見出し、本発明を完成するに至った。

[0017]

[0018]

すなわち、本発明は例えば下記の事項からなる。

[0019]

[1] 式(1)

 $CR^{1}R^{2}R^{3}COOQ \qquad (1)$

(但し、 $R^{1} \sim R^{3}$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、Qはアルキル基を示す。)で表されるエステル化合物と式(2)

$$CR^{4}R^{5}R^{6}COCH_{2}R^{7}$$
 (2)

(但し、 $R^4 \sim R^6$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、 R^7 は、水素原子または炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基を示す。)で表されるケトン化合物とをアルカリ金属アルコキシド触媒の存在下に反応させる工程1を含むことを特徴とする式(3)

$$CR^{1}R^{2}R^{3}COCHR^{7}COCR^{4}R^{5}R^{6}$$
 (3)

(但し、 $R^1 \sim R^7$ は、上記と同じ意味を示し、かつ $R^1 \sim R^6$ の少なくとも一つは 水素原子である。) で表される β ージケトン化合物の製造方法。

[0020]

[2] 式(1)

$$CR^{1}R^{2}R^{3}COOQ \qquad (1)$$

(但し、 $R^{1} \sim R^{3}$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、Qはアルキル基を示す。)で表されるエステル化合物、アミド系溶媒および尿素系溶媒から選ばれる少なくとも1種以上の化合物を溶媒として使用することを特徴とする[1]に記載の β -ジケトン化合物の製造方法。



[0021]

[3] 式(1)で表される化合物がイソ酪酸アルキルエステルであり、式(2)で表される化合物が3ーメチルブタノンであり、式(3)で表される化合物が2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンであることを特徴とする[1]に記載の2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンの製造方法。

[0022]

[4] イソ酪酸アルキルエステルを溶媒として使用し、それ以外の溶媒を使用しないで反応させることを特徴とする[3]に記載の2,6ージメチルー3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

[0023]

[5] 溶媒としてアミド系溶媒または尿素系溶媒を使用することを特徴とする[3]に記載の2、6ージメチルー3、5ーヘプタンジオンの製造方法。

[0024]

[6] 溶媒がN, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンおよび1, 3-ジメチル-2-イミダブリジノンから選ばれる溶媒の1種または2種以上であることを特徴とする[5] に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

[0025]

[7] 溶媒がN, N-ジメチルホルムアミドおよび/または1, 3-ジメチルー2-4ミダゾリジノンであることを特徴とする[6]に記載の2, 6-ジメチルー3, 5-4プタンジオンの製造方法。

[0026]

[8] 溶媒使用量が3-メチルブタノンの3質量倍 ~ 3 0質量倍であることを特徴とする [4] \sim [7] のいずれかに記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

[0027]

[9] アルカリ金属アルコキシド触媒のアルカリ金属がナトリウムまたはカリウムであることを特徴とする [3] \sim [8] のいずれかに記載の 2, 6-ジメチル-3, $5- ^{-0}$ $9 \times ^{-0}$



[10] アルカリ金属アルコキシド触媒のアルコール部分が3級のアルコールであることを特徴とする[9]に記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンの製造方法。

[0029]

[11] アルカリ金属アルコキシド触媒の使用量が3-メチルブタノンに対して、 $1\sim1$ 0倍モルであることを特徴とする[3] \sim [10] のいずれかに記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

[0030]

[12] イソ酪酸アルキルエステルと3-メチルブタノンとをアルカリ金属アルコキシド触媒の存在下反応させ2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンを合成する工程1と2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの反応液に酸を加えて中和し、水を添加して2層分離させて2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンを油層として分離することにより単離する工程2を含むことを特徴とする [3] \sim [11] に記載のいずれかに記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

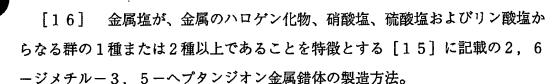
[0031]

- [13] 酸が硫酸、塩酸および硝酸から選ばれる1種または2種以上であることを特徴とする [12] に記載の2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオンの製造方法
- [14] [12] または [13] に記載の製造方法で得られた 2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオンを含む油層から、油層に含まれるイソ酪酸アルキルエステル、3-メチルブタノン、溶媒を蒸留により分離回収し、反応に再利用する 2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオンの製造方法。

[0032]

[15] [3] ~ [14] のいずれかに記載の方法により得られた2, 6 - ジメチル- 3, 5 - \wedge $\sqrt{2}$ $\sqrt{$

[0033]



[0034]

[17] 金属塩が、金属の塩化物および/または硝酸塩であることを特徴とする [16] に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0035]

[18] 金属塩の金属が、遷移金属および/またはアルカリ土類金属の1種または2種以上であることを特徴とする [15] ~ [17] のいずれかに記載の 2.6 -ジメチル-3、5 - $^{-}$ ペプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0036]

[19] 金属が、アルカリ土類金属、希土類金属、Ti、Zr、Hfおよび Cuからなる群より選ばれた1種または2種以上であることを特徴とする[18]に記載の2、6-ジメチル-3、5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0037]

[20] 2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンと金属塩との反応において、溶媒として親水性溶媒を使用することを特徴とする[15]~[19]のいずれかに記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0038]

[21] 親水性溶媒が炭素として $1\sim4$ 個を含むアルコール類であることを特徴とする[20]に記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0039]

[22] アルコール類がメタノールであることを特徴とする [21] に記載の2、6-ジメチル-3、5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0040]

[23] 反応終了後、水を添加して、2,6ージメチルー3,5ーヘプタン



ジオン金属錯体を析出させて、単離することを特徴とする $[15] \sim [22]$ のいずれかに記載の2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0041]

[24] 2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体が、金属1原子に対し、2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンが2~4分子配位している金属錯体であることを特徴とする[15]~[23]のいずれかに記載の2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体の製造方法。

[0042]

[0043]

[26] 2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体を蒸気化して使用することを特徴とする[25]に記載の金属または金属化合物の製造方法。

[0044]

[27] 化学気相成長法を用いることを特徴とする[26]に記載の金属または金属化合物の製造方法。

[0045]

[28] 金属または金属化合物が金属酸化物であることを特徴とする [25] ~ [27] のいずれかに記載の金属酸化物の製造方法。

[0046]

[29] 金属酸化物が金属酸化物被膜であることを特徴とする [28] に記載の金属酸化物被膜の製造方法。

[0047]

【発明の実施の形態】

以下本発明の詳細について説明する。

[0048]

本発明は、式(1)



$CR^{1}R^{2}R^{3}COOQ \qquad (1)$

(但し、 $R^1 \sim R^3$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、Qはアルキル基を示す。)で表されるエステル化合物と式(2)

$$CR^{4}R^{5}R^{6}COCH_{2}R^{7}$$
 (2)

(但し、 $R^4 \sim R^6$ は、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示し、 R^7 は、水素原子または炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基を示す。)で表されるケトン化合物とをアルカリ金属アルコキシド触媒の存在下に反応させ、式(3)

$$CR^{1}R^{2}R^{3}COCHR^{7}COCR^{4}R^{5}R^{6}$$
 (3)

(但し、 $R^1 \sim R^7$ は、上記と同じ意味を示し、かつ $R^1 \sim R^6$ の少なくとも一つは水素原子である。)で表される β — ジケトン化合物を製造することが特徴の一つである。

[0049]

以下、 β ージケトン化合物として、特に有用な2, 6ージメチルー3, 5ーへ プタンジオンを例として説明する。

[0050]

本発明の方法はイソ酪酸アルキルエステル及び3-メチルプタノンから有機溶媒中でアルカリ金属アルコキシド触媒を用いて、2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンを製造する方法に関するものである。本発明で用いられるイソ酪酸アルキルエステルは、式(1)の R^1 ~ R^3 がの二つがメチル基、一つが水素原子である構造であるが、エステルのアルコール部分であるQはアルキル基であれば特に制限はない。通常炭素数1個~6 個のアルキル基であるのが好ましい。例えば、イソ酪酸メチル、イソ酪酸エチル、イソ酪酸イソプロピル、イソ酪酸ブチル等を例示することができる。

[0051]

2, 6-iジメチルー3, 5-iペプタンジオン以外の本発明の $\beta-i$ ジケトン化合物を製造する場合には式(1)の化合物として、イソ酪酸アルキルエステル以外にプロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、ピバリン酸メチル、吉草酸メチル等も使用することができる。



[0052]

Qにフェニル基を用いた場合、エステルの反応性自体は向上するものの、脱離するフェノールの酸性が強い為、触媒と反応してアルカリ性の弱いアルカリ金属フェノキシドを生成し、反応を著しく阻害する。

[0053]

出発原料である3ーメチルブタノンは、特に制約はなく市販のものを用いることが出来る。

[0054]

2, 6-iジメチルー3, 5-iペプタンジオン以外の本発明の $\beta-i$ ジケトン化合物を製造する場合には式(2)の化合物として、3-iメチルブタノン以外にピナコロン(3、3-iジメチルー2-iグタノン)、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソプロピルケトン等も使用することが出来る。

[0055]

本発明の反応は使用する溶媒により反応性が著しく異なるが、反応当初には特別溶媒を使用せず、イソ酪酸アルキルエステルを大量に使用し、溶媒とすることができる。

[0056]

イソ酪酸アルキルエステル以外の溶媒を使用する場合には、アミド系溶媒または尿素系溶媒を用いると反応が促進される。アミド系溶媒としては、反応条件下で液状であり、アミド結合を有する化合物、例えば、N, Nージメチルホルムアミド (DMF)、N, Nージメチルアセトアミド (DMAc)、Nーメチルー2ーピロリドン (NMP)があげられ、尿素系溶媒としては、反応条件下で液状であり、尿素結合を有する化合物、例えば、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン (DMI)があげられる。特にDMFやDMIは、カルボニル基に対してα位に水素が存在せずカルボアニオンを生成しないので、カルボアニオンとケトンやエステルとの縮合反応による副反応を抑制できるため好ましい。これらの溶媒は単独でも2種以上混合しても使用可能であり、さらに、反応に悪影響が無い限り他の溶媒を併用することは可能であるが(例えば、触媒のアルカリ金属アルコキシドと作用、反応するような溶媒は使用できない。)、アミド系または尿素系



以外の溶媒のみを用いると反応性は著しく低下する。使用する溶媒は水を含有していると反応を阻害する為、脱水して使用することが望ましい。

[0057]

本発明のイソ酪酸アルキルエステルを溶媒として使用する場合の使用量、アミド系または尿素系溶媒の使用量としては、下限値は反応系の撹拌が可能である限り制限されない。また、上限値は特に制限はないが、反応系が希薄すぎると生産性、反応性が低下するので好ましくはない。すなわち、溶媒の使用量は、3ーメチルプタノンに対して、質量基準では、0~50質量倍使用するのが好ましい。より好ましくは1~40質量倍であり、殊更好ましくは、1~30質量倍であるまた、溶媒の使用量は、3ーメチルブタノンに対して、モル基準では、0~70倍モル使用するのが好ましい。より好ましくは0.2~50倍モルであり、殊更好ましくは、0.5~20倍モルである。

0

[0058]

反応に使用するイソ酪酸アルキルエステルの量は3ーメチルブタノンに対し、0.5~10倍モル、好ましくは1~5倍モル、更に好ましくは1.1~3倍モルが使用される。イソ酪酸アルキルエステルに対し3ーメチルブタノンの量が多すぎると、3ーメチルブタノンの自己縮合による影響が大きくなり収率が低下する為好ましくない。逆に多すぎる場合は未反応のイソ酪酸アルキルエステルを多量に回収しなくてはならない。しかし、イソ酪酸アルキルエステルを溶媒として使用した場合には、原料としてのイソ酪酸アルキルエステルと溶媒のイソ酪酸アルキルエステルは反応系内では区別される訳ではないので、イソ酪酸アルキルエステルはステルは反応系内では区別される訳ではないので、イソ酪酸アルキルエステルは3ーメチルブタノンに対し、10~30質量倍使用されることになる。

[0059]

イソ酪酸アルキルエステルおよび3-メチルブタノンの添加方法は特に制限は無く、反応開始前に一括で仕込むことや、先に3-メチルブタノンを仕込んでイソ酪酸アルキルエステルを徐々に添加する、或いはイソ酪酸アルキルエステルと3-メチルブタノンを同時に添加することも可能であるが、好ましくは3-メチルブタノンの自己縮合を防止する為に、イソ酪酸アルキルエステルが3-メチル



プタノンよりも反応液中で過剰になるように、先にイソ酪酸アルキルエステルを 仕込み、3-メチルブタノンを徐々に添加することが望ましい。イソ酪酸アルキ ルエステルや3-メチルブタノンの添加は、そのまま添加してもよいし、使用す る溶媒に溶解して添加してもよい。

[0060]

反応温度は0℃~150℃の範囲内、好ましくは20℃~100℃の範囲内であることがよい。反応温度が低い場合は、反応性が悪くなり反応時間が長くなり生産性が低下する。反応温度が高い場合は、アルカリによる溶媒の分解や副反応の促進などの影響により収率が低下する。

[0061]

反応に使用されるアルカリ金属アルコキシド触媒は、どの様な化合物でも使用可能であるが、好ましいアルカリ金属はナトリウムまたはカリウムであり、更に好ましくはカリウムが使用される。アルコキシドを形成するアルコールは、炭素数1~6の枝分かれしていてもよいアルキル基を有するモノアルコールが通常用いられるが、多価アルコール(例えば、エチレングリコール、プロピレングリコールがあげられる。)、アルキル基の炭素鎖の一部が酸素で置換したアルコキシアルコール(例えば、エチレングリコールのモノアルキルエーテルがあげられる。)でも構わない。好ましくは、3級のアルキル基を有するアルコールがよい。例えばtertーブトキシカリウムが例示される。

[0062]

これらアルカリ金属アルコキシド触媒は単独でも二種以上を任意の割合で組み合わせて使用しても良い。加える塩基の量は、少ない場合は反応性が悪く、また多すぎる場合はアルカリによる溶媒の分解や副反応による収率低下を招く。3-メチルブタノン1モルに対して1~10モルの範囲内とするのがよい。

[0063]

イソ酪酸アルキルエステルと3ーメチルプタノンをアルカリ金属アルコキシド 触媒のもとにクライゼン縮合反応することにより2,6ージメチルー3,5ーへ プタンジオンを合成した場合、生成した2,6ージメチルー3,5ーへプタンジ オンはアルキル金属塩として存在する。2,6ージメチルー3,5ーへプタンジ



オンを単離するには、2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンのアルカリ金 属塩を酸で中和してフリー体化する。

[0064]

使用する酸は、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸等の鉱酸、ギ酸、酢酸、などの有機酸、塩化第一鉄、塩化第二鉄、塩化第一スズ、塩化アルミ等のルイス酸が例示できる。好ましくは硫酸、塩酸、硝酸が用いられる。これらの酸成分は単独でも2種以上を任意の割合で組み合わせて使用しても良い。加える酸の量は生成した反応に使用したアルカリ金属アルコキシド触媒に対して当量以上であれば良い。中和時には発熱するので必要に応じて冷却する。

[0065]

反応により生成した2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンを回収する為に反応液に水を加えて、反応により生成した2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオン、イソ酪酸アルキルエステル、3ーメチルブタノン及び溶媒からなる油層と水、溶媒、及び無機塩からなる水層に2層分離させ、分離回収する。この際2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンは疎水性基を持つので殆ど水に溶けない為、抽出助剤が無くても良好な回収率で得られるが、必要ならば炭化水素やエーテル、芳香族炭化水素等を加えて抽出してもよい。

[0066]

このようにして分離した油層は必要に応じて蒸留精製することが可能である。 イソ酪酸アルキルエステル、3-メチルプタノン及び目的物より低沸点の溶媒は 、容易に除去回収し反応に再利用することができる。

[0067]

前記本発明の方法で製造した2,6-ジメチルー3,5-ヘプタンジオンを金属錯体とする方法は特に制限はなく、例えば、Inorganic Synthesis,31 (1997)に記載の方法を用いて製造することができるが、通常は有機溶媒中で金属塩と反応させることにより製造できる。

[0.068]

2. 6-iジメチルー3. $5-\alpha$ プタンジオン金属錯体の金属としては、 $\beta-i$ ジ



ケトンと金属錯体を形成できる金属であれば、特に制限はないが、好ましいものは、アルカリ土類金属、希土類金属、Ti、Zr、Hf、Sn、Fe、Al、Mn、Co、Ni、Zn、Ga、Pd、Cd、InおよびCuである。アルカリ土類金属としては、例えば、Sr、Baがあげられ、希土類金属としては、例えば、Y、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Tmをあげることができる。

[0069]

[0070]

2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンとの反応に用いる金属塩は、特に制限はないが、無機系のイオンの塩であることが好ましい。例えば、ハロゲン化物、硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩、過塩素酸塩をあげることができる。特に好ましくは、硝酸塩、塩化物である。これらの塩は、単独でも混合物として用いてもよい。

[0071]

[0072]

2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンと金属塩との反応に用いる溶媒は、有機溶媒であれば、特に制限はなく用いることができる。好ましくは金属塩を溶解しうる溶媒である。従って、極性溶媒、特に親水性の溶媒が好ましく、特に好ましくは、炭素を1個から4個有するアルコール系の溶媒である。例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、メトキシエタノール、エトキシエタノールをあげることができる。

[0073]

反応温度は、溶媒の融点以上、沸点以下の温度であり、特に室温付近で反応す



れば、何ら問題はない。従って、10 \mathbb{C} \sim 40 \mathbb{C} の温度が好ましく特に好ましくは 15 \mathbb{C} \sim 35 \mathbb{C} である。

[0074]

反応により得られた2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオン金属錯体は、 溶媒が疎水性の場合は濃縮することにより得られるが、通常使用する親水性の溶 媒の場合には、水を添加することにより、固体として、析出してくるので、濾過 、遠心分離等により単離することが可能である。金属によっては、水を特別添加 しなくとも析出してくることもある。

[0075]

2, 6-iジメチルー3, 5-iペプタンジオン金属錯体は、公知の化学気相成長法により金属酸化物とすることができる(例えば、第4版実験化学講座13、46頁)。例えば、2, 6-iジメチルー3, 5-iペプタンジオン金属錯体を蒸気とし、酸素を含むガスと混合し、加熱することにより、金属酸化物とすることができる。

[0076]

このようなプロセスの代表例としては、MOCVDがあげられる。MOCVDは、有機金属化合物を原料とし、基板近傍で熱分解させることにより結晶成長を行う技術の総称であり、現在、化合物半導体をはじめ、磁性体、強誘電体薄膜、高温超伝導体結晶など酸化物形成技術として利用されている。具体的には、減圧反応器内で基板を加熱し、基板近傍に有機金属化合物ガスおよび必要に応じ酸素を導入し、高周波電力による誘導加熱やプラズマ発生によって、基板表面あるいは基板近傍で熱分解反応を行い、基板表面に金属膜や酸化物膜を形成する。

[0077]

MOCVDでは、原料の有機金属化合物として、本発明で得られる β -ジケトン金属錯体やその誘導体を用いることは知られており、配位子である β -ジケトンの側鎖の炭化水素基を適宜に選択することによって、有機金属化合物の分解性や蒸発温度を制御することができる。

[0078]

【実施例】



以下、実施例を示すが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

[0079]

[0080]

<ガスクロマトグラフィー条件>

装置: 島津製作所株式会社製 GC-14A

スプリット法(スプリット比60)

カラム:J & W 社製 DB-5 0.25 mm $\phi \times 30$ m 膜 \mathbb{P} 0.25 μ

キャリアーガス:ヘリウム

注入量: 1μL

INJ. TEMP. :250℃

DET. TEMP. (FID) :280℃

温度プログラム:50℃→5min. hold→10℃/min. で250 ℃まで昇温

定量方法:内部標準法(内部標準物質:ナフタレン)

<実施例1>

DMF103g、tertープトキシカリウム1.33モル (149g)を1 L四つ口フラスコに入れ、メカニカルスターラーで攪拌しながら50℃まで加熱 し、イソ酪酸エチルエステル2.64モル (307g) と3ーメチルー2ープタ ノン0.88モル (75.6g)を混合した液を滴下ロートで3時間かけて添加 し、更に8時間加熱攪拌を続けた。ガスクロマトグラフィーにより液中2,6ー ジメチルー3,5ーヘプタンジオンが0.68モル (107g)生成している事 を確認した。(収率77.3% (3ーメチルプタノンベース))

<実施例2~12>

原料のケトンとエステルの種類を変えた以外(使用原料のモル数を同じにした)は実施例1と同様にし β -ジケトンを合成した。その結果を表1に示す。



[0081]

【表1】

	坂本	17%	35%	633	76%	76% 55%	76% 55% 45%	76% 55% 45% 35%	76% 55% 45% 35% 48%	76% 55% 45% 35% 48% 60%	76% 55% 35% 48% 60% 54%	76% 55% 45% 48% 60% 60% 61%
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ハナン		パポン	ハオ	いな	ゲン	*** ****	が、ないない。	がない。	オン オン オンジオン
生成物	B-ジケトン	5ーヘプタンジオン	ーくかキンジャン	ーヘキサンジオン	5ーヘプタンジオン	ーヘンタンジャンジャンジャンジャン	ーヘプタンジ タンジオン	ーヘプタンジ タンジオン	5ーヘプタンジオン プタンジオン 6ーオクタンジオン	- 3, 5-ヘプタンジ 5-ヘプタンジオン ジオン ジオン - 3, 5-オクタンジ 6-オクタンジオン	ーヘプタンジ タンジオン - オクタンジ タンジオン	ジメチルー3, 5ーヘプタンジオン ルー3, 5ーヘプタンジオン ヘプタンジオン ヘキサンジオン ジメチルー3, 5ーオクタンジオン ルー3, 5ーオクタンジオン ノナンジオン 6ートリメチルー3, 5ーヘプタンジオン
	B-3	ო	2ージメチルー3, 5	5	l − 3.	チルー3, 5 3, 5ーヘブ	7-8. 15-16. 14.	2ージメチルー3, 5 メチルー3, 6ーヘブ 5ーヘプタンジオン 4ーヘキサンジオン	2ージメチルー3, 5 メチルー3, 5ーヘブ 5ーヘプタンジオン 4ーヘキサンジオン 2ージメチルー3, 5	チルー3, 5 3, 5ーヘブ タンジオン サンジオン サンジオン チルー3, 5 3, 5ーオク	4 1 1 2 2 2 2 3 3 4 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 ドトー3・6 イナー3・6 イナンジャートング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イ
		2, 6ージメチルー	2, 2ージメ		2, 2ージメ	2, 2ージメ 2ーメチルー	2, 2ージメ 2ーメチルー 3, 5ーヘプ	2, 2ージメ 2ーメチルー 3, 5ーヘブ 2, 4ーヘキ	2, 2ージメ 2ーメチルー 3, 5ーヘプ 2, 4ーヘキ 2, 2ージメ	2, 2ージメチル 2-メチルー3, 3, 5-ヘプタン 2, 4-ヘキサン 2, 2ージメチル 2-メチルー3,	2, 2ージメチルー3 2ーメチルー3, 5ー3, 5ー3, 5ー7タンジオ 2, 4ーヘキサンジオ 2, 2ージメチルー3 2ーメチルー3, 5ー4, 6ー/ナンジオン	2, 2ージメ 2ーメチルー 3, 5ーヘブ 2, 4ーヘキ 2, 2ージメ 2ーメチルー 4, 6ーノナ 2, 2, 6ー
							ケトン	ケトン	ケトン	イトングイング	ケトン	イン イン イン イン
原料	ケトン	3ーメチルー2ーブタノン	ピナコロン	メチルインプロピルケトン	ピナコロン	ピナコロン メデルイソプロピルケトン	ピナコロン メチルイソプロピル メチルエチルケトン	ピナコロン メチルイソプロピル メチルエチルケトン メチルエチルケトン	ピナコロン メチルイソプロピ メチルエチルケト メテルエテルケト ピナコロン	ピナコロン メチルイソプロピルケトン メチルエチルケトン メチルエチルケトン ピナコロン メチルインプロピルケトン	ピナコロン メチルイソプロピルケ メチルエチルケトン メチルエチルケトン ピナコロン メチルイソプロピルケ メチルイワプロピルケ	ピナコロン メチルイソプロピルケトン メチルエチルケトン メチルエチルケトン ピナコロン ドナコロン メチルイソプロピルケトン メチルプロピルケトン メチルプロピルケトン
道		3-	ピナ	メル	チルピナ							
	エステル	/酪酸エチル	エチル	きエチル	ピオン酸エ	ピオン酸エ ピオン酸メ	ピオン酸エ ピオン酸メ ピオン酸メ	ピオン酸エピオン酸エピオン酸スピオン酸メニアン酸スピオン酸スピカン	オオオチチチ酸酸酸	オオオチャン インシャ の で は カンシャ ル ル ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス	オオオチチチチチ	オイン酸 オイン酸 オート オート オート オート オート マート マート マート マート マート マート マート マート マート マ
		ン	酢酸	酢酸	プロ	プログログ	プププ	プププ音	プロピ プロピ 野酸エ 路酸メ	プロピ プロピ 酢酸エ 酪酸メ	プププロ 単語 路路 路路 なる 日日日 な 数数 数数数数 は ピピピュメメメ	アプロ問題の記号は関数を受ける日日日は数数を強い、

致



[0082]

<比較例1>

実施例1の方法と同様にイソ酪酸エチルをイソ酪酸フェニルに変えて反応したところ、2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオンは生成しなかった。

<実施例13>

実施例1の方法で合成した2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオンを含む 反応液に濃塩酸133.7gを加え、更に水773gを加えたところ油層と水層に2層分離した。回収した油層をGCにより分析したところ2,6ージメチルー3.5ーヘプタンジオンの回収率は99.5%であった。

<実施例14>

30%純度のナトリウムメチラートメタノール溶液 14.5g(0.081モル)をメタノール 51.4gに撹拌しながら溶解し、室温まで冷却した。97% 純度の 2,6 ージメチルー 3,5 ーヘプタンジオン 12.65g(0.081モル)を少量ずつ添加した。純度 81.3%の $Y(NO_3)_3 \cdot 6H_2O(定量により純度を求めた。) <math>12.63g(0.0268$ モル)を 63.2gのメタノールに溶解して、30分かけて 25~ 28 $\mathbb C$ で添加した。 1 時間反応させ、析出した結晶を濾別した。得られた結晶を酪酸エチルを溶媒として再結晶し、トリス(2,6 ージメチルー 3,5 ーヘプタンジオナト)イットリウム 7.46g(収率 50.2%) を 得た。

<実施例15>

30%純度のナトリウムメチラートメタノール溶液66.9g(0.372モル)をメタノール178gに溶解し、室温まで冷却した。88%純度の2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオン66.0g(0.377モル)を撹拌しながち滴下した。純度99%のFe(NO3)3・9H2O50.0g(0.124モル)を12.0gのメタノールに溶解して、30分かけて25~28℃で添加した。1時間反応させ、析出した結晶を濾別し、得られた溶液に水400gを1時間30分かけて滴下した。滴下終了後、1時間撹拌し、得られた結晶を遠心分離により取り出し、乾燥した。トリス(2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオナト)鉄62.0g(収率95.9%)を得た。



<実施例16>

メタノール300gに撹拌しながら87%の2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオン77.1g(0.429モル)を滴下した液に、99%純度のZrC1425.0g(0.106モル)をメタノール100gに溶解し、室温に冷却した溶液を5分程度で滴下した。1時間、撹拌、反応させ、水1000gを1時間かけて添加し、1時間撹拌した。20%NaOH溶液でpH6.6に調整し、得られて結晶を遠心分離で取得した。乾燥後、テトラキス(2,6ージメチルー3,5ーヘプタンジオナト)ジルコニウム74.5g(収率97.5%)を得た

< 実施例17>

30%純度のナトリウムメチラートメタノール溶液 7.20g(0.04000 のモル)をメタノール 20g に溶解し、室温まで冷却した。 87% 純度の 2,6 ージメチルー 3,5 ー 0 ー 0 ー 0 ー 0 と 0 の 0 と 0 の 0 の 0 と 0 を 0 を 0 を 0 を 0 の 0 に 0 の 0 に 0 の 0 に 0 の 0 に 0 の 0 に 0 の 0 に 0 に 0 の 0 に

<実施例18、比較例2>

実施例11で製造したY(DMHD) $_3$ を用いてMOCVD法により Y_2O_3 の 成膜を行った結果(実施例18)を示す。また、比較のためY(DPM) $_3$ で行った結果(比較例2)も併せて示す(DPM:2, 2, 6, 6-テトラメチル3, 5-ヘプタンジオン、別名:ジピバロイルメタン)。

[0083]

原料錯体はメタノールに 20 w t %溶解させて、定量ポンプで気化器に送液した。

[0084]

この時Y(DMHD) 3とY(DPM) 3は時間あたり同じモルになる量で行った。

MOCVD法の条件は以下の通り。



[0085]

キャリアガス: 窒素

気化器温度:250℃

基材:Si(100)

成膜時間:25分

基材温度 350 \mathbb{C} の時、原料に Y (DMHD) 3 を用いた場合、450 nmの Y_2O_3 膜が成膜された。一方同条件で原料に Y (DPM) 3 を用いたところ 15 0 nmの Y_2O_3 が成膜された。

[0086]

同様に基材温度 300 \mathbb{C} で成膜したところ Y (DMHD) $_3$ を用いた場合は Y_2O_3 の膜が生成した事が確認されたが、 Y (DPM) $_3$ を使用した場合は Y_2O_3 の膜が確認されず、 DHMDでは低温での成膜が可能である事が確認できた。

[0087]

【発明の効果】

本発明により、取り扱いの容易なアルカリ金属アルコキシドを触媒として用いることが可能となり、温和な条件で、設備的にも多額の投資の必要なしに、2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオンを安価に製造できる。

[0088]

製造した2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオンは金属と配位して錯体を合成可能であり、MOC V D 原料である2, 6-ジメチルー3, 5-ヘプタンジオン金属錯体を安価に提供可能となった。



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 イソ酪酸アルキルエステルのようなエステル化合物と、3-メチルブタノンのようなケトン化合物とを原料として、2, 6-ジメチル-3, 5-ヘプタンジオンのような $\beta-$ ジケトン化合物を製造するに際し、アルカリ金属アルコキシドを触媒として使用できる方法を提供することを課題の-つとする。

【解決手段】 本発明は、 $CR^1R^2R^3COOQ$ で表されるエステル化合物と、 $CR^4R^5R^6COCH_2R^7$ で表されるケトン化合物とをアルカリ金属アルコキシド触媒の存在下に反応させる工程1を含むことを特徴とする $CR^1R^2R^3COCHR^7COCR^4R^5R^6$ で表される β -ジケトン化合物の製造方法に関する。(但し、それぞれ独立に水素原子または炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、 R^7 は、水素原子または炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を示、かつ $R^1\sim R^6$ の少なくとも一つは水素原子である。)

【選択図】 なし



特願2003-165200

出願人履歴情報

識別番号

[000002004]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月27日

新規登録

住 所 氏 名 東京都港区芝大門1丁目13番9号

昭和電工株式会社